PAT-NO:

٠

JP358105047A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 58105047 A

TITLE:

MONOLITHIC TYPE TEMPERATURE-HUMIDITY SENSOR

PUBN-DATE:

June 22, 1983

INVENTOR-INFORMATION: **NAME** IWANAGA, SHOICHI SATO, NOBUO IKEGAMI, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP56203683

APPL-DATE:

December 18, 1981

INT-CL (IPC): G01N027/12, G01K007/16

US-CL-CURRENT: 29/595, 374/141

ABSTRACT:

PURPOSE: To lower the heated temperature of a temperature sensor due to the heat cleaning of a humidity sensor and thereby to prolong the lifetime of the temperature sensor by a constitution wherein the temperature and humidity sensors are formed monolithically on a heat-resisting insulating substrate and the temperature sensor is made adiabatic from the humidity sensor.

CONSTITUTION: A hater 2 for heat cleaning and an electrode 3 used for a humidity sensor are formed on an alumina substrate 1 by using platinum paste. A humidity-sensitive body 4 is formed by applying paste containing the powder of MnWO<SB>4</SB> so that it covers the opposite electrode 3, and thus the humidity sensor is formed. A comb-shaped electrode 5 used for a temperature sensor is formed by using silver-palladium paste. A temperature-sensitive body 6 is formed by applying paste containing the mixture of the powder of Mn<SB>3</SB>O<SB>4</SB>-Co<SB>3</SB>O<SB>4</SB>-

A1<SB>2</SB>O<SB>3</SB>

thermistor and the powder of borosilicate lead binder glass so that it covers the opposite electrode 5, and thus a temperature sensor is formed. An adiabatic slit 7 is provided between the humidity sensor and the temperature sensor on the substrate 1 by a laser processing machine.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO& Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭58—105047

6) Int. Cl.³ G 01 N 27/12 G 01 K 7/16 識別記号

庁内整理番号 6928-2G 7269-2F 砂公開 昭和58年(1983)6月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全5頁)

60一体型温度・湿度センサ

願 昭56-203683

願 昭56(1981)12月18日

⑫発 明 者 岩永昭一

@特

邻出

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

炒発 明 者 佐藤信夫

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究 所内

砂発 明 者 池上昭

横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立製作所生産技術研究

所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

⑭代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 (細 🛊

- 1 発明の名称 一体型温度・健度センサ
- 2 特許請求の範囲

湿度を検知する湿度検知部と温度を検知する 温度検出部が耐熱性絶縁基板上に一体的に形成 され、かつ、該湿度検知部と該温度検知部が熱 的に絶縁されたことを特徴とする一体型温度・ 湿度センサ。

3 発明の詳細な説明

本発明は空間機、計測器、環環設備,乾燥機をよび食品関理器などの湿度をよび温度検出に利用される一体形態温・感湿素子に関するものである。

一般に、健康検知には感湿抵抗体案子、機械式湿度制御業子などが使用され、温度検知には熱質対やサーミスタなどが使用されている。マイクロコンピュータの実用化にともない各種機器の自動化が普及しはじめ、湿度検知におけて対は電気信号の処理が有利な感湿抵抗体素子に対する必要性が高まっている。感磁抵抗体は健度

に敏感に感応してその抵抗値を変化させる性質を有し、湿度測定用素子として、あるいは湿度調整用センサとして利用されている。 周知のように、感促抵抗体は $F_{i,0}$ O_4 N_iO Al_i O_5 L_i O_6 $-V_i$ O_5 M_g Cr_1 O_4 $-T_iO_2$ T_iO_5 $-V_2$ O_5 等の吸湿性に優れた金属酸化物から形成されている。また、敏近では生産性の大巾な向上、歩留りの改きた、銀立て工程の自動化およびコストの低減を目的に、厚膜製造工程を使用した感湿抵抗体素子が出現するにいたっている。

一方、サーミスタは周知のように、金属酸化物半導体の導電率が温度によって敏感に変化する性質を有し温度測定用素子として、あるいは温度調整用センサとして各種機器に利用されている。また生産性の向上や電子回路との一体形成が容易などの長所をもつ學膜型のサーミスタも製品化されている。

ところで各種の機器においては湿度検出のみを行なえば足りる場合は少なく、ほとんどの場合に湿度検出の必要がある。

本発明はかかる点に着目してなされたものでまず第1の目的は安価で長寿命の一体形感温・ 感湿素子を得ること、第2の目的はこの一体形 感温・影湿素子によりそれが設置されている雰 出気の温度信号、湿度信号を各々独立に得るこ とにある。

本発明は、アルミナ・ステアタイト等耐熱性 絶縁基板上に通常の厚膜製造工程によって温度

. 5 .

トが大きくなり、温度センサの検知精度が劣化する。これに対してをせると、選度センサを選集というしたというと、選度センサを加熱クリーニングになる。となり、選度センサの温度は200℃以るとなり、選度センサの加熱クリーニングになる。 下温度を検知することができる。

また、本発明は上述した一体形温度・湿度センサにおいて、温度センサによりセンサ周囲の雰囲気健康信号を検出し、湿度センサからの温度依存性をもつ雰囲気の湿度信号と上記雰囲気の温度信号とを演算処理することにより雰囲気の湿度信号のほかに温度依存性のない雰囲気の促度信号を得ることができる。

次に本発明による温度・型度センサについて 実施例を示す。

実施例1

第1図に示すごとく、5%×8%×0.5%の

虚度センサを一体形成し、かつ酸温度センサと 酸湿度センサを断熱することにより、温度セン サの加熱クリーニングによる温度センサの加熱 温度を下げ、一体型温度・湿度センサの粉命を 長くしたものである。

次いで、Mn WO。粉末を 10cps エチル セルロース 10 ωt 9 α テルビネール溶液とよく混練し、このペーストを対向電極を覆うごとくスクリーン印刷法で塗布し約 50 μの 摩さの 感湿体 4 を形成した。この基板を乾燥し、電気炉に入れて徐々に升温して敷終的に 1100 ℃で焼成し湿度センサを形成した。

次に、級 - パラジウムペーストを用いてスクリーン印刷法により基板 1 の促胺センサの隣接

—270—

面に温度センサに用いる櫛形電極 5 を形成した。 互いにかみ合った対向電極の関隔は 0.2 % とした。この基板を乾燥、鋭成して電極 5 を有する ※板を得た。

次いで、Mn₁O₄ - Co₁O₄ - Al₂O₃ サーミスタ粉末とホウケイ酸鉛パインダガラス粉末の混合粉を 10 cps エチルセルロース 10 wt 8α-テルビネオール溶液とよく混練し、このペーストをスクリーン印刷法で対向電極を覆うごとく基板に登布し、約 50 μの 厚さの 8温体 6 を形成した。この 基板を電気炉に入れ、徐々に昇温して 最終的に 850 ℃ で 6 成し温度 センサを形成した。

・ 後に基板にレーザ加工機により隣接した湿度センサの間に巾 200 μ 長さ 5.5 mm のスリット 7 を設け、断熱した一体型温度・健度センサを製造した。

上述した一体型センサについて湿度センサを500℃で加熱クリーニングしたと、色熱伝導により温度センサの温度は 200℃で、断熱しない場合に比べ 200℃ 以上低くすることができた。

. 7 .

なお、本発明の一体型センサにおいてスリットの幅は 150~550 μ の間が適している。スリット幅が 150 μ以下では断熱の効果がなくなり温度センサの温度が 500で以上となった。また、350 μ以上にすると基板の強度が十分でなくなることが明らかとなった。

第2図に示すどとく、5 %×8 %× 0.5% の アルミナ基板をトリクロルエチレンで洗浄した 後、白金ペーストを用いスクリーン印刷法によ り基板1 に加熱クリーニング用ヒータ2を形成 した。この基板を乾燥器成してヒータ2を有す る基板を得た。

宴施例2

次いで、白金ペーストを用いスクリーン印刷 法により基板 1 上、ヒータと反対面に健康セン サに用いる電極 3 を形成した。この基板を乾燥 焼成してヒータ 2 および下部電極 3 を有する基 板を得た。

次いて M n W O4 粉末を 10 cps エチルセルロース の 10 w t π α - テルピネオ - ル溶液とよく混練し 更にこの一体型センサについて優皮を抵抗値でいたが値では、常温で10分間放置する加熱クリーニングによる健皮をから00でであるためでは、常温で10分間放置する加熱クリーニングによる健康となりの抵抗値では、0.5で以下でこのかなが、温度を出ては、0.5で以下でよの対していいないが、温度を出ている。というとは、10で以上となり、対命が比較的短かいる。

また、本発明の一体型温度、虚度センサは通常の厚膜印刷工程とレーザ加工技術によって製造できるためきわめて生産性がよく、小型なパッケージにハンジングできるためルームエアコン等家電機器に通している。

8

次に、鍛・パラジウムペーストを用い、スクリーン印刷法により別のアルミナ基板 7 に電優 8 を形成した。各電優 8 はそれぞれ櫛状に分岐し、互いにかみ合い対向電極を形成し、その間 際は 0.2 % である。この基板を乾燥焼成して電極 8 を有する 3 板を得た。

次いで、Mn₂O₄ - Co₈O₄ - Al₂O₃ サーミスタ粉 米とホウケイ酸鉛パインダガラス粉末の混合粉 を 10 cps エチルセルロース 10 wt αテレビネオ - ル裕液とよく促練し、スクリーン印刷法を用 いてこのベーストを使うごとく基板 7 に塗布し約 50 4 の呼さの感温体 9 を形成した。次いてこの基板を乾燥し、電気炉に入れ除々に昇温して 敷終的に 850℃で焼成した。

数後に温度センサを先に形成した湿度センサの 跨接面のガラスパット 6 上に塔載し、電気炉で 加熱して湿度センサ基板に接着することにより ガラスで断熱接合した一体型温度・湿度センサ を形成した。上述した一体型センサにおいてガ ラスハット 6 の高さは 0.2 % 大きさは 0.3 % × 0.3 % とした。

上述した一体型センサについて実施例 1 と同様に温度センサを 500 C で 加熱クリーニングしたときの熱伝導による温度センサの温度は220 C で断熱しない場合に比らべ 180 C 以上低くすることができた。

型に、この体型センサについて温度センサの 加熱クリーニングによる温度センサの抵抗値の ドリフトは8万回で25以下で、温度検出精度 では0.5で以下で実施例1と同様にこの一体型セ

- 11 ·

#TC に予め変換しておく。 演算処理回路の出力
#B は 雰囲気の健康 信号となる。16 および 17は
温度 および 湿度の酸定回路で、その出力 #TS および 混度の酸定回路で、その出力 #TS および #B を出力する。15は変度 は 号 # B を出力する。15は 変度 の変質 処理回路 12 が主として 波算が主体である。 たまに 変 処理回路 12 が主として 波算が主体である。 たい 出力 # TB のでは 快適指数 表示・温度・健康 画者を一体化したとき 快適制

このように本発明の一体形温度・湿度センサにおいて温度センサでセンサ周囲の雰囲気温度信号を検出し、温度依存性をもつ健度センサの雰囲気の湿度信号と上記雰囲気の温度信号とを演算処理することにより、雰囲気の温度信号を得ることができる。

この発明によれば、安価で小型で、しかも長寿命な--体型温度・湿度センサを提供すること

ンサもきわめて特性が安定しており、かつ長寿 命であることが示された。

また本発明の一体型温度・湿度センサも通常の厚膜印刷工程で製造でき、ガラスパッドによる湿度センサ基板への温度センサの接合も印刷工程と自動機による搭載が可能であるので、自わめて生産性にすぐれ、低価格で製造することができる。

さらに本実施例において、ガラスパッドで温度センサを格載している湿度センサ基板に前述したスリットを散ければ、さらに効果的な断熱ができ、長寿命な一体型温度、湿度センサが得られることはいうまでもない。

次に第3図に信号処理方法の一実施例を示す。
10 は一体形温度、湿度センサで思温体の検知する雰囲気温度信号を・7、思促体の被知する雰囲気湿度信号を・2とする。11は上記・7の特性変換回路で出力を・7cとする。12の演算処理回路で・2と・7cより・2中の温度依存性を除去することができるように特性変換回路11で・7の値を

· 12 ·

4 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による一体型温度・湿度センサの構成図、第2図はこの発明による別の実施例による一体型温度・温度センサの構成図、第3図は一体型センサの温度信号・17 および温度依存性をもつ湿度信号・2の処理方法の一例を示すプロック図である。

1 基板

2 ヒ - タ

5 促 皮 セ ン サ 電 種

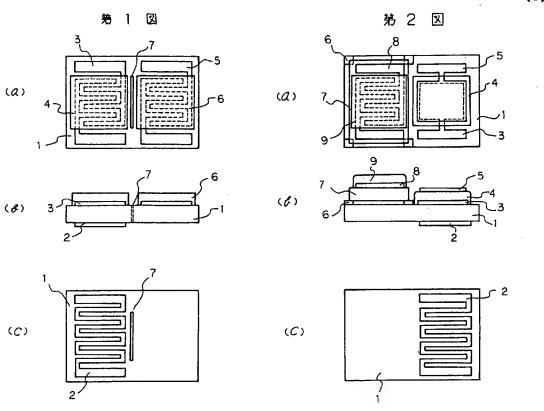
5 温度センサ電極

7 断熱スリット

代理人弁理士 薄田



特願G58-105047(5)



第3図

